### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06191033 A

(43) Date of publication of application: 12.07.94

(51) Int. CI B41J 2/05 B41J 2/175

(21) Application number: 04346348

(71) Applicant:

**CANON INC** 

(22) Date of filing: 25.12.92

(72) Inventor:

KOBAYASHI MASATSUNE

SHIMOMURA AKIHIKO

**AONO KENJI** 

### (54) INK JET RECORDING HEAD AND APPARATUS

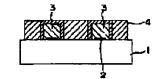
#### (57) Abstract:

PURPOSE: To enhance the durability of constitution for eliminating emission non-stability such as the deflection of emission generated by the ink droplet bonded to the emitting orifice surface of an ink jet recording head.

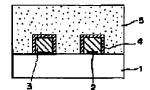
CONSTITUTION: An ink passage 6 provided with an emission energy generating element 2 is formed from an ink passage constituting member 4 having hydrophilicity and the periphery of the member 4 is formed from an ink passage constituting member 5 more hydrophobic than the member 4. By this constitution, almost all of the periphery of the emitting orifice provided to the leading end part of the ink passage 6 is formed from a hydrophobic member and the adhesion of an ink droplet can be well prevented.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japin

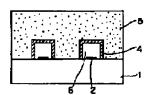
(A)



(B)



(C)



#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

#### (11)特許出豐公開番号

## 特開平6-191033

(43)公開日 平成6年(1994)7月12日

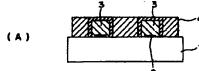
(51) Int.Cl. <sup>5</sup> B 4 1 J	2/05 2/175	<b>微羽記号</b>	庁内整理書号 9012-2C 8306-2C	FΙ	技術表示箇所				
				B41J	3/04	103 B 102 Z			
					存主情求	未請求	請求	頃の数6(全	13 頁)
(21) 出職番号		<del>特顯平4</del> -346348		(71)出職人	000001007 キヤノン株式会社				
(22) 出蓋日		平成4年(1992)12	(72)発明者	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 小林 正恒 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ					
			•	(72)発明者	ノン株式	<b>大会社内</b>			
					ノン株式	会社内	于3~	丁目30書 2 号	<b>ナキヤ</b>
				(72)発明者	東京都大		<b>1子</b> 37	丁目30番2年	<b>ナキヤ</b>
				(74)代理人	弁理士	谷養	- 4	外1名)	

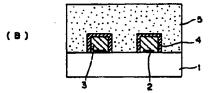
#### (54) 【発明の名称】 インクジェット記録ヘッドおよびインクジェット記録装置

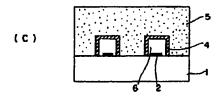
### (57) 【要約】

【目的】 インクジェット記録ヘッドにおいて、その吐出口面に付着したインク演等によって生じる吐出傷向等、吐出の不安定性を解情するための構成の耐久性を向上させる。

【構成】 吐出エネルギー発生来于2が設けられたインク路6は、親水性を有するインク路等構成部材4によって構成され、この部材4の周囲は、部材4よりも耐水性であるインク路等構成部材5によって形成される。これにより、インク路6の先端部の吐出口の周囲は、そのほとんどが疎水性の部材によって形成され、インク液の付着を良好に防止できる。







1

#### [特許請求の範囲]

【請求項1】 インクを吐出するための記録ヘッドにお いて、

インクを吐出するための吐出口と、

狭吐出口に連通するインク路と、

該インク路を構成し親水性材料よりなる第1の部材と、 該第1の部材の回りに形成されかつ前記吐出口の周囲の 面をなす疎水性材料よりなる第2の部材と、

を具えたことを特徴とするインクジェット記録ヘッド。 【請求項2】 インクを吐出するための記録ヘッドにお 10 れてきた。 いて、

インクを吐出するための吐出口と、

該吐出口の周囲の面であって、原子%で、Ta30以上 60以下, Fe30以上50以下, N13以上7未満, Cr7以上15以下を含むアモルファス合金が被覆され た吐出口面と、

を具えたことを特徴とするインクジェット記録ヘッド。 【請求項3】 前配配録ヘッドは、熱エネルギーを利用 してインクに気泡を発生させ、酸気泡の生成に基づいて 配載のインクジェット記録ヘッド。

【請求項4】 被記録媒体にインクを吐出して記録を行 うインクジェット記録装置において、

インクを吐出するための記録ヘッドであって、

インクを吐出するための吐出口と、

核吐出口に連通するインク路と、

試インク路を構成し観水性材料よりなる第1の部材と、 該第1の部材の回りに形成されかつ前配吐出口の周囲の 面をなす疎水性材料よりなる第2の部材と、

を有した記録ペッドを具えたことを特徴とするインクジ 30 エット記録装置。

【請求項 5】 被記録媒体にインクを吐出して記録を行 うインクジェット記録装置において、

インクを吐出するための記録ヘッドであって、

インクを吐出するための吐出口と、

該吐出口の周囲の面であって、原子%で、Ta30以上 60以下, Fe30以上50以下, N13以上7未満, Cr7以上15以下を含むアモルファス合金が被覆され た吐出口面と、

を有した記録ヘッドを具えたことを特徴とするインクジ 40

【請求項6】 前配配録ヘッドは、熱エネルギーを利用 してインクに気泡を発生させ、該気泡の生成に基づいて インクを吐出することを特徴する酵求項4または5に記 載のインクジェット記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、インクジェット記録へ ッドおよび酸ヘッドを用いたインクジェット記録装置に 関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェット配像ヘッドに用いられる 吐出方式として、圧電素子の変形によりインク路内に圧 力変化を発生させて微小インク資を吐出させるもの、あ るいはさらに一対の電極を設けて、これによりインク濱 を偏向して吐出させるものが知られている。またインク 路内に配設した発熱楽子を急激に発熱させることによっ てインク中に気泡を生ぜしめ、その気泡の生成に基づい て吐出口からインク資を吐出させるもの等が種々提案さ

【0003】これらの中でも、熱エネルギーによって発 生する気泡の生成に基づいてインクを吐出する方式にか かるインクジェット記録ヘッドは、吐出口を高密度に配 列することができるために高解像力の記録をすることが 可能であること、記録ヘッドとして全体的コンパクト化 も容易であること、最近の半導体分野における技術の進 歩と信頼性の向上が著しい「C技術やマイクロ加工技術 の長所を十二分に活用でき、長尺化および面状化(2次 元化)が容易であること等により、マルチノズル化およ インクを吐出することを特徴とする請求項1または2に *20 び*高密度実装化が容易で、しかも大量生産時の生産性が 良く製造費用も麻価にできるものとして特に注目されて いる。

> 【0004】上述したように、インクジェット記録ヘッ ドは、一般に、インクを吐出するための吐出口、この吐 出口に連通するインク路およびこのインク路の一部に設 けられる吐出エネルギー発生素子を具えている。さら に、複数のインク路の各々に連通してこれらインク路に 供給されるインクを貯留した共通液室が具えられてい

【0005】そして、このようなインクジェット記録へ ッドを製造する方法としては、例えば、ガラスや金属等 の基板に切削やエッチング等により、上記インク路等を 構成するための微細な牌を形成した後、この牌を形成し た基板を他の意当な基板と接合してヘッド内にインク路 および共通被室を形成する方法が知られている。

【0006】また、特開昭61-154947号公報に は、以下のような製造方法によるインクジェット記録へ ッドが記載されている。

【0007】即ち、この配録ヘッドは、基板上にインク 路のパターン状に固体層を設ける工程と、この固体層が 設けられた前配基板上にインク路等構成部材の少なくと も一部を設ける工程と、固体層を基板上より除去する工 程を有した製造方法によって製造される。

【0008】なお、上配固体層には、ポジ型感光性材 料,例えばポジ型のドライフィルムが用いられ、またイ ンク路等構成部材には、被状で熱硬化,紫外線硬化,あ るいは電子ピーム硬化などの硬化性材料が好適なものと して用いられる。

【0009】ところで、以上示した記録ヘッドでは、使 50 用に際して吐出口が配設される面(以下、吐出口面とい

う)にインクが付着し、吐出されるインク滴がこの付着 インクに引張られ、吐出が十分な速度で行われなかった り、吐出方向が偏向することがある。また、付着インク が多くなるとスプラッシュや不吐出を生じることもあ

【0010】このため、このような吐出口面へのインク 付着に対する対策が求められてきた。特に、上述の特別 昭61-154947号公報に開示されているインクジ エット記録ヘッドの製造方法は、以下の点で従来の記録 ヘッド製造方法に比して優れているため、それらの利点 10 を扱わずに、上記インク付着の問題点を解決するための 構成が強く求められてきた。

【0011】すなわち、上記製造方法の利点として、

(1) ヘッド製作のための主要工程が、いわゆる印刷技 術。すなわちフォトレジストや感光性ドライフィルム等 を用いた微細加工技術に困るため、ヘッドの細密部を、 所望のパターンで、しかも極めて容易に形成することが できるばかりか、同構成の多数のヘッドを同時に加工す ることもできる。

【0012】(2) 製造工程数が少なく、生産性が良好 20 である.

【0013】ことを挙げることができる。

【0014】以上示した、吐出口面へのインク付着の問 騒点に対する構成として、以下の公報に開示されるもの を例示することができる。すなわち、上記吐出口面への インクの付着およびこれによって派生する問題は、吐出 口面の濡れ性あるいは撥水性を改善することによって解 決できるものとして、以下の各様成が例示される。

【0015】特開昭60-24957号,特開昭60-49951号の各公報には、樹脂製配録ヘッドにおける 30 インク路面の濡れ性改善方法が記載されている。

【0016】また、特開昭61-141565号公報に は、樹脂成形された配像ヘッドのインク路面の親水化処 理および吐出口面の強水処理が記載されている。

【0017】さらに、特開昭62-59049号公報に は吐出口面への撥水剤整布方法が示されている。

【0018】さらに、同様な構成の他の例として、実公 昭48-36188号公報には、吐出口面をシリコーン オイル、アラビヤゴム等で処理し撥水性を有するように する構成が記載されている。加えて、特関昭56-89~40 5669号公報には、吐出口面をフロロアルキルアルコ キシシラン等で撥水処理したものが記載されている。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記特 開昭60-24957号。特開昭60-49951号の 方法は、濡れ性を改善するための処理方法が技術的に困 難であること、また処理コストの増加、処理上の安全性 の問題等多くの困難な問題を生じ、かつ、濡れ性の効果 が時間とともに低下するという問題を有している。

示される構成についても、処理方法の技術的困難性、ま た、その効果の持続性に問題を有している。

【0021】さらに、上記特別昭62-59049号の 方法においても、処理面の効果の持続性に欠点を有して

【0022】さらに加えて、上配実公昭48-3618 8号に記載される構成は、飛液処理層が吐出口面を構成 するガラス、金属、樹脂等の材料との密着性がそれ程良 好でないため、浣液層の耐久性が劣るということがあ る。また、洗液性が全てのインクに対して有効に作用せ ず、例えば水系のインクに対して有効な発液性を作用し ても、アルコール系等の有機溶剤系インクに対してはほ とんど作用しないという問題もある。

【0023】また、上記特開昭56-895669号に 配載される構成は、発被処理を完全に行う場合、高温で 長時間加熱したり、高PHの核中で加熱する等、吐出口 形成材料を破壊する恐れがある。

[0024]なお、上述した従来の構成とは別の構成と して、本出願人は、特顧平1-327291号におい て、吐出口面を輸水性を有する部材で形成し、最終工程 で吐出口を打抜き工程によって形成する構成を提案して いる。しかしながら、この打抜き工程のための非常に作 業性が低下し、かつ穴抜き時のパリ発生等により記録へ ッドの吐出安定性が低下する恐れを有している。

【0025】本発明は、上配従来の問題点に觸みてなさ れたものであり、吐出口面へのインク付着に起因した吐 出の不安定を解消するための構成の特に耐久性を向上さ せたインクジェット配像ヘッド及び酸ヘッドを用いたイ ンクジェット記録装置を提供することにある。

[0026]

【課題を解決するための手段】そのために本発明では、 インクを吐出するための配録ヘッドにおいて、インクを 吐出するための吐出口と、該吐出口に連選するインク路 と、該インク路を構成し観水性材料よりなる第1の部材 と、鉄第1の部材の回りに形成されかつ前記吐出口の周 囲の面をなす疎水性材料よりなる第2の部材と、を具え たことを特徴とする。

【0027】また、インクを吐出するための配録ヘッド において、インクを吐出するための吐出口と、酸吐出口 の周囲の面であって、原子%で、Ta30以上60以 下,Fe30以上50以下,N13以上7未費,Cr7 以上15以下を含むアモルファス合金が被覆された吐出 口面と、を具えたことを特徴とする。

【0028】さらに、被配縁媒体にインクを吐出して配 録を行うインクジェット記録装置において、インクを吐 出するための記録ヘッドであって、インクを吐出するた めの吐出口と、骸吐出口に連通するインク路と、骸イン ク路を構成し親水性材料よりなる第1の部材と、鉄第1 の部材の回りに形成されかつ前記吐出口の周囲の面をな 【0020】また、上記特開昭61-141565号に 50 す疎水性材料よりなる第2の部材と、を有した記録ヘッ

5

ドを具えたことを特徴とする。

【0029】さらに、被配條條体にインクを吐出して記録を行うインクジェット記録装置において、インクを吐出するための記録ヘッドであって、インクを吐出するための吐出口と、該吐出口の周囲の面であって、原子%で、Ta30以上60以下,Fe30以上50以下,N13以上7未満,Cェ7以上15以下を含むアモルファス合金が被覆された吐出口面と、を有した記録ヘッドを具えたことを特徴とする。

[0030]

【作用】以上の構成によれば、吐出口面の少なくともほぼ全てを疎水性とすることができ、インク演等の付着を 防止することができる。

【0031】また、上配疎水性を有する材料または層は、摩擦等に対して耐久性があるため、疎水性を長く維持できる。

[0032]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細 に説明する。

【0033】(実施例1)図1ないし図4は、本発明の 20 実施例1にかかる記録へッド説明するための図である。 なお、これら図には、2つの吐出口を有するインクジェット記録へッドが示されるが、もちろんこれ以上の吐出口を有する記録へッドの場合、あるいは1つの吐出口を有する記録へッドの場合でも、本発明は同様に適用されることは曾うまでもない。

【0034】図1は、本実施例1にかかる配録ヘッドの製造工程の一部を示す斜視図である。

【0035】記録ヘッドの構造部材をなす基板1は、ガラス、セラミック、プラスチック、あるいは金属等によ 30って形成される。このような基板1はインク路を構成する部材の一部として機能し、また、後述の型およびインク路等構成部材積層時の支持体として、機能する。従って、これらの機能を構たすものであれば、その形状、材質等に特に限定されることはない。

【0036】上記基板1上には、電気熱変検案子あるいは圧電案子等の吐出エネルギー発生素子2が、吐出口の数に応じて配設される(図1では2個)。このような吐出エネルギー発生案子2によってインク摘を吐出させるためのエネルギーがインクに与えられ、吐出が行われる。

【0037】因に、何えば吐出エネルギー発生素子2として、電気熱変換案子が用いられるときには、この素子が近傍のインクを加熱することにより、インク中に気泡を生じさせこの気泡の生成に基づいて吐出が行われる。また、何えば、圧電素子が用いられるときには、この素子の機能的接動によって、インク中に圧力変動を生じさせこの圧力変動によって吐出が行われる。なお、これ等の素子2には、これら素子を動作させるための吐出信号入力用電極(不図示)が接続されている。また、一般に

は、これら吐出エネルギー発生素子の機能の十分な発揮,保護等を目的として保護層等の各種の機能層が設けられるが、もちろん、本例においてもこのような機能層を設けることは一向に差しつかえない。

6

【0038】図2(A)および(B)は上配図1に示す工程の次の工程を示す配録ヘッドの平面図および断面図である。

【0039】吐出エネルギー発生素子2が設けられた基板1上のインク路等形成予定部分に、図に示されるパターンの型3を形成する。上配型3は、後述するようなインク路等構成部材が積層された後、基板1から除去されるものであり、この除去によって2つのインク路およびこれらに連通する共通核室が構成される。

【0040】これらインク路等の形状は所望のものとすることが可能であり、インク路等形成のために設けられる型3も、インク路等の形状に応じたものとすることができる。本例では2つの吐出エネルギー発生牽子に対応して設けられる2つの吐出口のそれぞれからインク濱を吐出させるため、インク路は、2つ設けられる。

び 【0041】このような型を形成するに際して用いられる材料および手段としては、例えば下記に列示するものが具体的に好ましいとして挙げられる。

【0042】(1) 感光性ドライフィルムを用い、公知のドライフィルムのパターン形成プロセスに従って、型3を形成する。

【0043】(2) 基板1上に所定の厚さの溶剤可溶性 ポリマーおよびフォトレジスト層を順に積層し、このフ ォトレジスト層のパターン形成後、溶剤可溶性ポリマー 層を選択的に除去する。

り 【0044】 (3) 硬化性を有するか、または、非硬化 性の樹脂を印刷する。

【0045】なお、(1) に挙げた感光性ドライフィルムとしては、ポジ型のものもネガ型のものも用いることができる。

【0046】(2) に挙げた溶剤可溶性ポリマーとしては、それを溶解する溶剤が存在し、コーティングによって被膜形成し得る高分子化合物であればいずれでも用いられ得る。

出エネルギー発生素子2によってインク摘を吐出させる [0047] (3)に挙げた印刷法によって型を形成すためのエネルギーがインクに与えられ、吐出が行われ 40 る材料としては、例えば煮発乾燥型、熱硬化型あるいは 紫外線硬化型等の各々の乾燥方式で用いられる平板イン キ、スクリーンインキ等が用いられる。

【0048】以上に挙げた材料群の中で、加工特度や除去の容易性あるいは作業性等の点から、上配(1)に示される感光性ドライフィルムを用いるのが好ましい。しかしながら、後の工程で除去可能であれば、どのような材料あるいは方法を用いて型を形成してもよい。

せこの圧力変動によって吐出が行われる。なお、これ等 【0049】図3(A), (B) および(C) は、図2の素子2には、これら素子を動作させるための吐出信号 に示す工程の次の工程を順を迫って示す配録ヘッドの断入力用電極(不図示)が接続されている。また、一般に 50 面図であって、図2(B)と同位置の断面を示す。

【0050】型3が形成された基板1には図3 (A) お よび(B)に示されるように、型3を覆うように2種の インク路等構成部材4および5が積層される。

【0051】すなわち、本発明が適用されるにあたって は、インク路等構成部材は、少なくとも2種の材料を用 い、そのうち一方は、親インク性であり、他方は前者に 比較して疎インク性である材料が用いられる。

【0052】まず、図3(A)に示されるように、基板 1上に形成された型3上に最初に親インク性材料からな (B) に示すように、疎インク性材料からなるインク路 等構成部材5を積層する。

【0053】ここで、本発明の目的とする社出口期期の インクの付着を効率的に防止するためには、インク路等 構成部材4の層をできるだけ薄くすることが望ましい。

【0054】このうちインク路等構成部材4を構成する 親インク性材料としては、液状で熱硬化,紫外線硬化あ るいは電子ピーム硬化する硬化性材料が好ましく、中で もエポシキ樹脂、アクリル樹脂、ジグリコールジアルキャ \*ルカーポネート書脂,不飽和ポリエステル樹脂,ポリウ レタン樹脂,ポリイミド樹脂,メラミン樹脂,フェノー ル樹脂、尿素樹脂等が好ましく用いられる。また電解メ ッキ、蒸着、スパッタリング等で形成できる金属も好意 に用いられる。これらを例示すれば、Cu, Ag. A u, Ni, Cr, Sn, Pb, Zn. Al, Ti等であ る。また蒸着やスパッタリングを用いれば、金属の酸化 物等も用いることができる。

【0055】また、インク路等構成部材5を構成する疎 るインク路等構成部材4の層を形成し、次いで、図3 10 インク性材料としては、シリコーン系ポリマー、または フッ素系ポリマーが代表的なものとして挙げられるが、 実質的に水溶性で有機溶剤可溶性のフッ素系重合体およ び重合硬化性のモノマーおよび/またはオリゴマーを主 体とする重合硬化性被覆膜形成組成物の硬化膜が特に舒 ましい.

【0056】これらを例示すれば、

[0057]

【化1】

(1) C. FirSO. NCH. CH. OCOC (CH.) = CH. とフッ素

# 非含有アルキルメタアクリレートとの共重合体

C. H17

(平均分子量2,000~20,000)

[0058] (2) CnF:..1 CH: CH: OCOCH  $= CH_2 \quad (n = 1 \sim 16)$ 

あるいは、CnF:..: CH: OCOCH=CH: (n=

あるいは、CnF::+:OCOCH=CH: (n=2~ 30 上含有されるものが好ましい。 8) と平均分子量約5,000のメチルメタクリレート マクロマーとのモル比2:1~4:1の共重合体(平均 分子量2,000~40,000)

- (3) C10 F11 CH2 CH2 OH, PPG-5000\$ よびトリレンジインシアナートとのモル比2:1:2の ポリウレタン (平均分子量 5.900)
- (4) C<sub>1</sub> F<sub>17</sub>SO<sub>2</sub> N (CH<sub>2</sub> CH<sub>1</sub> OH) 1 , ポリ エチレングリコールおよびアジビン酸とのモル比1: 3:4のポリエステル (平均分子量4,700)

上記以外に、重合体主鎖中にポリフロロアルキレン基を 40 れ用いることで硬化膜を形成できる。 有する重合体等のフッ素系重合体と多価アルコールに (メタ) アクリル酸が2個以上付加された多価アクリレ ート,多価アルコールと、多塩基酸から得られるポリエ ステルポリオール (メタ) アクリル酸が2個以上付加さ れたポリエステルアクリレート、エポキシ樹脂のエポキ シ基を(メタ)アクリル酸でエステル化し、官能基をア クリロイル基としたエポキシアクリレート、多価イソシ アネートにヒドロキシ (メタ) アクリレートを反応させ て得られるポリウレタンアクリレート等、分子中に2個

一または、多官能性オリゴマーの組合わせが好ましく利 用できる。

【0059】この組合わせの場合、フッ素系重合体は、 全体の0.01重量%以上、好ましくは0.1重量%以

【0060】以上に述べた重合硬化性被覆膜形成組成物 は、これが盤布された後、熱、光、電子線のエネルギー を与えることによって架構重合硬化し硬化膜を形成す

【0061】この硬化において、重合開始エネルギーと して熱を利用する場合は、アゾピスイソプチロニトリ ル、ペンゾイルパーオキサイドのような熱重合関始剤 を、衆外線のような光を利用する場合は、ペンソフェノ ン、ペンジルメチルケタールのような光開始剤をそれぞ

【0062】電子線で硬化させる場合には、特に、開始 剤の添加を要してない。

【0063】なお、上記に述べた重合硬化性被覆膜形成 組成物中には、その他に、反応性希釈モノマー、溶剤お よびその他各種添加剤を加えることができる。

【0064】以上、本発明に用いることができる好まし い疎インク性材料の例を示したが、本発明に使用できる 疎インク性材料はこれらに限定されるものでなく、その 他のフッ末ポリマー、またシリコーン系ポリマーを条件 以上の(メタ)アクリロイル基を有する多官能性モノマ 50 に応じて選択し、使用することが可能である。

-241-

g

【0065】上記に述べた2種類のインク路等構成部材は、例えば、カーテンコート、ロールコート、スプレーコート等の公知の手段を用い、これを整布する等の方法によって、所定の厚さで基板上に積層される。整布に際しては、材料の脱気を行った後、気泡の混入を避けながら行うのが好ましい。ここで、例えば図3(A)および(B)のようにインク路等構成部材を積層する際、例えば、液体の流出、流動を抑制した状態で、必要ならば、上部に抑え板を重ね、所定の条件で硬化させることもできる。硬化条件が常温または、加熱硬化であれば、3010分~2時間放置すれば良く、紫外熱硬化などの場合は、通常10分以内の短時間照射によって硬化が可能である。

【0066】次いで、図3(C)に示されるように、型3およびインク路等機成部材が積層された上記のような基板から、型3のみを除去してインク路6および共通液塞10を形成する。型3の除去手段としては、特に限定されるものではないが、具体的には、例えば、型を溶解または膨張あるいは制能する液体中に基板を浸漬して除去する等の方法が好ましいものとして挙げられる。この20 際、必要に応じて超音波処理、スプレー、加熱、撹拌、その他の除去促進手段を用いることも可能である。

【0067】上記除去手段に対して用いられる液体としては、例えば、含ハロゲン炭化水素,ケトン,エステル,芳香族炭化水素,水,強アルカリを含む水等が挙げられる。

【0068】なお、図4は型3の溶解除去に先立ってインク供給ロ7を設け、その後に型を除去した後のインクジェット記録ヘッドの模式的斜視図である。

【0069】本例の場合、型3は、この型を溶解する液 30体中に浸漬され、吐出口8と供給口7を介して溶解除去される。

【0070】なお、溶解除去に先立ち、吐出口部分が、 露出していない場合は、例えば図4に示すC-C'線に 沿って基板全体を切削して(必要に応じ研磨する),吐 出口を露出させる。しかし、このような配録ヘッド先端 部の切断の操作は本発明の実施のために必ずしも必要で なく、例えば、インク路等構成部材として被状の硬化性 材料を用い、この材料を積層する際に型を使用し、配録 ヘッド先端の吐出口部分が硬われてしまうことがなく、 且つ吐出口面が平滑に成型されるようにした場合等に は、切断は不要である。

【0071】なお、図4に示される記録ヘッドにおいては、インク路等構成部材について、観インク性インク路等構成部材を区別して、図示していないが、図3(C)に示すような構成であることは勿論である。

【0072】以上、本発明のインクジェット記録ヘッドの製造方法について説明したが、ここでいう観インク性、構成部材はインク路や共通液室の内壁においてインクの漏れが向上することを目的とするものである。このため、できるだけ観インク性の高い構造材を用いることが必要であり、これは用いるインクの材料によって変化してくるものである。本明観書中では、水性のインクを用いることを例にとって説明している。

10

【0073】また、逆に疎インク性構成部材は、できるだけインクを弾く、すなわちインクに対して濡れ性の悪い材料を選択することが必要である。これらの2種の構造材を積層する際に、必要に応じてその境界面をシランカップリング材等で処理することも可能である。

【0074】また、上述したように、親インク性材料のインク路等構成材の層厚はできるだけ薄く、1~10μmが好ましい。逆に、疎インク性材料からなる層の厚さは、オリフィスの周辺面(オリフィス面)での発インク性を充分に発揮させる意味からもできるだけ大きくしてた方が好ましい。

20 【0075】以上説明した製造手順によるインクジェット記録へッドの具体例を以下に示す。

【0076】まず、吐出エネルギー発生素子としての電 気熱変換素子(HfB, 等よりなる)を形成したガラス 基板上に、ポジ型ドライフィルム「OZATEC R2 25」(ヘキストジャパン(株))から成る厚さ50 μ mの感光層をラミネーションによって形成した。

【0077】この感光層にインク路等に相当するパターンのマスクを重ね、インク路や共通被室の形成予定部分を除く部分に70mJ/cmgの紫外線照射を行った。この場合、インク路の長さは3mmであった。

【0078】次に1%のカセイソーダ水溶液にてスプレー現像を行い、上記電気熱変換素子を含むガラス基板上のインク路等形成予定部分に厚さ約50μmのレリーフの固体層から成る型を形成した。

【0079】次いで、紫外線硬化性材料である「NOR LAND 81」(商品名、ノーランド(株)製)をその基板の上にディッピング法にて約10μmの厚さに塗布し、その後、平行度の高い紫外線照射装置である「タマラック」(TAMARACK scientific co-, inc製)によって紫外線を200秒照射し、親水性のインク路等構成部材を硬化させた。

【0080】その後、同様に以下の組成の重合硬化性被 極膜形成組成物を整布し、さらに紫外線を照射すること で疎インク性のインク路等構成層を100μmの厚さに て積層した。

[0081]

【化2】

C. Hir

Ca FirSO, NCH, CH2 OCOC (CHa) = CH2 とフッ素非含有 アルキルメタアクリレートとの共重合体 (平均分子量12,000)

35% (重量部)

12

テトラヒドロフルフリルアクリレート

25% (重量部)

 $CH_2 = C_1 CH_3 \cdot COOCH_2 CH_2 O_5 CO = C \cdot CH_3 = CH_2$ 

20%(重量部)

グロキュア1173

5% (重量部)

【0082】次いで、半導体用ウェハー切断装置を用い て、発熱素子先端から吐出口倒の100μmの位置を切 断した。この切断後、その基板をエチルセロソルナアセ テート中に浸漬し、超音波洗浄処理をして型を全て溶解 除去し、かつインク路等内を洗浄した。

【0083】このようにして製造されたインクジェット 記録ヘッドのインク路等中には型の残渣が全く存在しな 20 える。 かった。

【0084】また、このインクジェット記録ヘッドを記 録装置に装着し、純水/グリセリンダイレクトプラック 154 (水溶性黒色染料) = 65/30/5から成るイ ンクを用いて記録を行ったところ、吐出口の周囲にイン クが付着せず、その結果、吐出方向の偏向や、不吐出の ない安定な記録が可能であった。

【0085】上記実施例1の重合硬化性被覆膜形成組成 物の代りに、反応基としてアクリロイル基を含有する反 ジカル重合型樹脂組成物DEFENSA 7 7 0 2 (大日 本インキ化学工業(株)製)のフレオン溶液にて処理剤 を作成し、これを複数回弦布した後、紫外線を照射する ことにより、85μmの疎インク性インク路等構成層を 積層した。

【0086】この材料よりなる配像ヘッドの性能を評価 したところ、吐出口の周囲にインクが付着せず、その結 果、吐出方向の偏向や不吐出のない安定した配録が可能 であった。

かる記録ヘッドの外観斜視図であり、図6はその分解斜 視図である。

【0088】これら図に示されるように、本例の配録へ ッドでは、A「よりなる支持板25上に、シリコンより なる基板21が接着される。この基板21上には熱エネ ルギーを発生するための複数の電気熱変検索子やこれに 電力を供給するための電極配線、さらには配象信号に応 じて上記電気熱変検索子を駆動するための駆動回路等 が、半導体製造と同様の方法で形成されている。そし

板22が接合される。この天板22には、上記電気熱変 検索子に対応して設けられるインク路や複数のインク路 のそれぞれに連通して一時的にインクを貯留するための 共通被室を構成するための溝が形成される。また、天板 22は、インク路それぞれの先端で開口を構成する吐出 口28が形成されたオリフィスプレート23を一体に具

【0089】天板22の基板21への接合は、これらそ れぞれの接合面に用いられる接着剤と、弾性力によって 接合力を作用する押えばね24とによって行われる。

【0090】以上の記録ヘッド主要部の他に、上記駆動 回路とホスト装置との間の信号接続等を行うための配線 が設けられた基板27や、インクタンクに貯留されるイ ンクを、天板22に設けられる供給口27を介して共通 被室に導くためのインク路部材26が設けられる。

【0091】吐出口28を囲むオリフィスプレート23 応性オリゴマーと希釈モノマーなどから形成された光ラ SO の表面には、本発明にかかるアモルファス合金が被覆さ れている。このアモルファス合金は税液性(撥水性)を 有しており、これがオリフィスプレート表面に被覆され ることにより、吐出口周囲のインク滴、水滴の付着が生 ぜず、吐出偏向等の不安定吐出を防止することができ る。また、ゴムブレード等によるオリフィスプレート表 面のワイピングに対する耐久性を増すこともできる。

> 【0092】次に、上記アモルファス合金の成分組成の 限定について説明する。

【0093】吐出口を囲むオリフィスプレート表面を発 【0087】 (実施例2) 図5は本発明の実施例2にか 40 被性にすることによって、インク演等が付着せず、イン クが吐出口から吐出される際、その吐出方向の傷向等を 生じないようにするので、被覆するアモルファス合金が 充分な飛波性を有するかどうかが成分組成の条件にな る.

【0094】すなわち、アモルファス合金成分のうち、 Taは、税液性を有する元素であり、かつ、Niあるい はFeと共存してアモルファス構造を形成する元素であ る。従って本例においては、充分な浣液性を保証するた めに、Taを30原子%以上抵加する必要がある。しか て、この基板  $2\,1$  には、樹脂をモールド成形してなる天  $50\,$  し、 $6\,0$  原子%を越えて添加しても、それ以上の発液性

13

の向上は期待できないため、Taの含有量は30~60 原子%とする。

[0095] FeはNiおよびTaと共存することによ ってアモルファス構造を形成し得るが、Ta,Niおよ びCrを所要量含ませてアモルファス構造とし、発液性 を確保するためアe含有量の上限は50原子%とする。 また、20原子%よりも少ないと、アモルファス構造の 、 形成が困難になる。そのためFeの含有量は30~50 原子%とする。

【0096】N1は物性を増大させると共に、税液性を 10 高める。NIが3原子%未満ではこの効果が小さいが、 7原子%以上添加してもそれ以上に朝性および院被性は 向上しない。従って、Ni含有量は原子%で3以上7未 激とする。

【0097】 Cェは耐酸化性を高める。 Cェが7原子% 未満ではこの効果が小さい。逆に15原子%よりも多い と脆性化するおそれがあるので、Crの含有量は7~1 5原子%とする。

【0098】次に、アモルファス合金をオリフィスプレ **ート表面に被覆する表面処理方法について、以下に説明 20 ヘッドを構成した。** する.

【0099】樹脂モールドと一体に形成されるオリフィ スプレートに吐出口を加工する前に、メカニカルマスク にてオリフィスプレート表面を除いた部分をマスクし、 スパッタ法にて上配組成のアモルファス合金を被覆す る。統いて、オリフィスプレート表面の吐出口部分は特 密ドリルあるいはレーザーにて加工し吐出口を形成す

【0100】なお、既にオリフィスプレートに吐出口が スプレート表面を除いた部分をマスクし、さらに吐出口 内はワックス等特定の密剤で溶解しうる物質を充填し て、スパッタ法にて上記成分のアモルファス合金を被覆 する。さらに、吐出口内のワックス等を溶剤で溶解除去 する.

【0101】以上説明した本発明の実施例2にかかる記 録ヘッド製造方法のいくつかの具体例を以下に示す。

#### 【0102】具体例1

モールド成形された樹脂製のオリフィスプレート一体型 天板にメカニカルマスクにてマスクを行った後、オリフ 40 孔径10μm (東洋ポリマー製) ィスプレート表面にスパッタ法にて、原子%でTa:3 5 Fe: 47. 7 Ni: 5. 9 Cr: 11. 70 組成からなるアモルファス合金を被覆した。なお、この 合金の膜厚が 1. 0 μmになるようスパッタ時間をコン

トロールした。

【0103】次に、このアモルファス合金被覆したオリ フィスプレートに吐出口に対応したマスクをした後、レ ーザーにて吐出口を形成した。このようにして完成した オリフィスプレート一体型天板を、電気熱変換素子等を 有する基板に接合させ記録ヘッドを構成した。

#### [0104] 具体例2

既に、レーザーによって吐出口が加工されたオリフィス プレートー体型天板の吐出口内 (インク) 路等をワック スで充填した後、メカニカルマスクにてオリフィスプレ ート以外をマスクレ、スパッタ法にて、原子%でTa: 50 Fe:36.5 Ni:4.5 Cr9の組成か らなるアモルファス合金を被覆した。このとき膜厚が 1. 0 ミクロンになるようスパッタ時間をコントロール した。

【0105】次に、このアモルファス合金を被覆したオ リフィスプレート一体型天板の吐出口内のワックスを溶 解除去した。さらに、このオリフィスプレート一体型天 板を電気熱変換業子等が形成された基板に接合して記録

#### 【0106】比較例1

具体例1とまったく同一の方法で、オリフィスプレート 一体型天板に、合金(SUS304)を被覆し、記録へ ッドを形成した。

【0107】以上説明した具体例1, 2および比較例1 によるインクジェット配録ヘッドのオリフィスプレート における発液性の耐久性を調べるため、以下の「摩擦耐 久試験」を行った。

【0108】この「摩擦耐久試験1」は、オリフィスプ 形成されている場合は、メカニカルマスクにてオリフィ 30 レート表面にインクを吹きかけ、その上を以下に示す発 抱ポリウレタンシートでこすって行った。インクは表面 の摩擦に対して厳しいと考えられる以下に示す顔料イン クを用いた。評価は、処理した面の試験前後の水との接 触角を測定することによって行った。

【0109】試験条件は以下のようである。

【0110】インク組成:モノエタノールアミン 中和 等量の1.5倍,トナー30%, DEG20%, エタノ ール3.5%、水46.5%

こすり材料: 発泡ポリウレタンシート t=2.0.気

こすり回数:2000回

上記試験の結果を以下の表1に示す。

[0111]

【接1】